(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/205784 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/673 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/011757

(22) 国際出願日： 2025年3月25日(25.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-053541 2024年3月28日(28.03.2024) JP

(71) 出願人: ダイキンファインテック株式会社 (**DAIKIN FINETECH, LTD.**) [JP/JP]; 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町６番２号 (JP). 大日商事株式会社 (**DAINICHI SHOJI K.K.**) [JP/JP]; 〒1080023 東京都港区芝浦四丁目１５番３３号 (JP).

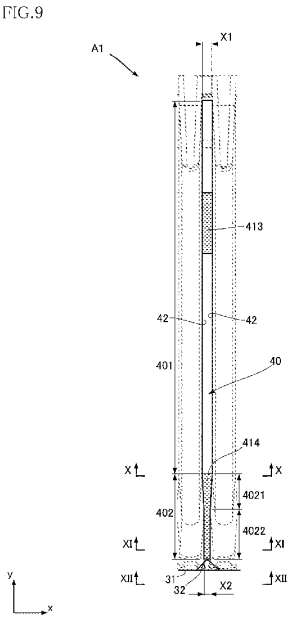
(72) 発明者: 牛田 慧 (**USHIDA Satoshi**); 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町６番２号 ダイキンファインテック株式会社内 (JP). 出口 泰紀 (**DEGUCHI Yasunori**); 〒6391031 奈良県大和郡山市今国府町６番２号 ダイキンファインテック株式会社内 (JP). 渡邊 直哉 (**WATANABE Naoya**); 〒1080023 東京都港区芝浦四丁目１５番３３号 芝浦清水ビル 大日商事株式会社内 (JP). 小関 智宏 (**KOSEKI Tomohiro**); 〒1080023 東京都港区芝浦四丁目１５番３３号 芝浦清水ビル 大日商事株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 臼井 尚, 外 (**USUI Takashi** et al.); 〒5430014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町２番３２－１３０１ (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,

(54) **Title:** WAFER HOLDER

(54) 発明の名称： ウエハ保持具



(57) **Abstract:** A wafer holder A1 holds a plurality of wafers in a state of being aligned in a first direction x such that the surfaces thereof face each other. The wafer holder A1 comprises two groove arrays 4 which each include a plurality of holding grooves 40 aligned in the first direction x and which are apart from each other in a second direction y orthogonal to the first direction x. In each of the holding grooves 40, one side in a third direction z orthogonal to the first direction x and the second direction y is open, the other side in the third direction z is at least partially closed, and a wide width part 401 and a narrow width part 402 are provided. The narrow width part 402 is positioned more inward in the second direction y as compared to the wide width part 401, and also on the other side in the third direction z. The width X2 of the narrow width part 402 in the first direction x at the end portion on the other side in the third direction z is smaller than the width X1 of the wide width part 401 in the first direction at the end portion on the other side in the third direction z. By such a configuration, a plurality of wafers can be more suitably aligned and held.

WO 2025/205784 A1

［続葉有］

SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能):ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一　国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約:ウエハ保持具Ａ１は、互いの表面が対向するように第１方向ｘに整列させた状態で複数のウエハＷを保持する。ウエハ保持具Ａ１は、第１方向ｘに配列された複数の保持溝４０を各々が含み、且つ第１方向ｘと直交する第２方向ｙにおいて互いに離れた２つの溝列４を備える。保持溝４０は、第１方向ｘおよび第２方向ｙと直交する第３方向ｚの一方側が開いており、且つ第３方向ｚの他方側の少なくとも一部が閉じているとともに、広幅部４０１および狭幅部４０２を有する。狭幅部４０２は、広幅部４０１より第２方向ｙにおける内側であって第３方向ｚの他方側に位置する。狭幅部４０２の第３方向ｚの他方側の端部における第１方向ｘの幅Ｘ２は、広幅部４０１の第３方向ｚの他方側の端部における第１方向の幅Ｘ１より小さい。このような構成により、複数のウエハをより適切に整列させて保持することができる。